

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第1区分

【発行日】令和4年8月23日(2022.8.23)

【国際公開番号】WO2020/035587

【公表番号】特表2021-534742(P2021-534742A)

【公表日】令和3年12月16日(2021.12.16)

【出願番号】特願2021-507781(P2021-507781)

【国際特許分類】

A 2 4 F 4 0 / 4 0 (2 0 2 0 . 0 1)

A 2 4 F 4 0 / 2 0 (2 0 2 0 . 0 1)

A 2 4 F 4 0 / 5 1 (2 0 2 0 . 0 1)

10

【F I】

A 2 4 F 4 0 / 4 0

A 2 4 F 4 0 / 2 0

A 2 4 F 4 0 / 5 1

【手続補正書】

【提出日】令和4年8月15日(2022.8.15)

【手続補正1】

20

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

エアロゾル発生物品とともに使用する電気加熱式のエアロゾル発生装置であって、前記エアロゾル発生物品の少なくとも一部分を受容するための前記装置の近位部分内に受容空洞を含む装置ハウジングと、

前記装置の前記近位部分内の前記受容空洞を前記装置の遠位部分から分離する前記受容空洞の遠位端に隣接して配設された分離壁と、

30

前記物品が前記受容空洞に受容された時に、前記物品内のエアロゾル形成基体を加熱するための少なくとも一つの電気加熱装置と、

磁界発生器を備える感知回路であって、前記磁界発生器が、前記分離壁に隣接する前記装置の前記遠位部分内に配設されていて、前記感知回路が、前記物品が前記受容空洞の中に受容されている時に前記物品内に配設された指標の存在によって引き起こされた前記磁界発生器の少なくとも一つの特性の変化を測定するように構成されている、感知回路と、を備える、装置。

【請求項2】

前記装置が、磁束集中器を備え、その少なくとも一部分が前記磁界発生器によって円周方向に包囲されていて、かつ前記分離壁に隣接する前記装置の前記遠位部分内に配設されている、請求項1に記載の装置。

40

【請求項3】

前記磁束集中器が少なくとも前記分離壁の中に延びる、請求項2に記載の装置。

【請求項4】

前記磁束集中器が前記分離壁を通過して前記装置の前記近位部分の中に延びる、請求項2または請求項3のいずれか一項に記載の装置。

【請求項5】

前記磁束集中器を収容する、または前記磁束集中器に隣接している前記分離壁の一部分の厚さが、前記分離壁の他の部分の厚さより小さい、請求項2～4のいずれか一項に記載

50

の装置。

【請求項 6】

前記磁束集中器がフェリ磁性材料を含むか、またはフェリ磁性材料から成る、請求項 2 ~ 5 のいずれか一項に記載の装置。

【請求項 7】

前記磁束集中器が長方形、四角形、円形、または楕円形の断面を有する円筒形状を有する、請求項 2 ~ 6 のいずれか一項に記載の装置。

【請求項 8】

前記磁束集中器が、前記受容空洞の中心軸に関して中心から外れて配設されている、請求項 2 ~ 7 のいずれか一項に記載の装置。

10

【請求項 9】

前記磁界発生器が誘導コイル、特にらせん状コイルまたは平坦な湾曲したスパイラルコイルである、請求項 1 ~ 8 のいずれか一項に記載の装置。

【請求項 10】

前記磁界発生器の前記少なくとも一つの特性が、前記磁界発生器のインダクタンスである、請求項 1 ~ 9 のいずれか一項に記載の装置。

【請求項 11】

前記感知回路と動作可能に連結されたコントローラをさらに備え、前記コントローラが、前記磁界発生器の前記少なくとも一つの特性の測定された変化と、前記磁界発生器の前記少なくとも一つの特性の変化の一つ以上の所定の値との比較に基づいて、前記加熱装置の動作を制御するように構成されている、請求項 1 ~ 10 のいずれか一項に記載の装置。

20

【請求項 12】

前記感知回路が、前記物品が前記受容空洞の中に受容されている時に前記物品内の前記指標の存在によって引き起こされた前記磁界発生器の少なくとも二つの特性の変化を測定するように構成されていて、かつ前記コントローラが、前記磁界発生器の前記少なくとも二つの特性の測定された変化と、前記磁界発生器の前記少なくとも二つの特性の変化の一つ以上の所定の値との比較に基づいて、前記加熱装置の動作を制御するように構成されている、請求項 1 ~ 11 のいずれか一項に記載の装置。

【請求項 13】

請求項 1 ~ 12 のいずれか一項に記載の電気加熱式のエアロゾル発生装置と、前記装置で使用するエアロゾル発生物品とを備えるエアロゾル発生システムであって、前記エアロゾル発生物品が、

30

エアロゾル形成基体と、

前記エアロゾル形成基体の少なくとも一部分を包囲するラッパーであって、特定の透磁率および特定の電気抵抗率を有する指標を含むラッパーと、を含む、エアロゾル発生システム。

【請求項 14】

前記指標が、前記ラッパーの内表面の少なくとも一部分に塗布されている導電性材料でできた薄膜または箔を含む、請求項 13 に記載のシステム。

【請求項 15】

前記指標が、前記物品の周囲の周りに閉ループ導電性経路を形成する、請求項 13 ~ 14 のいずれか一項に記載のシステム。

40